

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第1区分

【発行日】平成17年6月9日(2005.6.9)

【公開番号】特開2003-275653(P2003-275653A)

【公開日】平成15年9月30日(2003.9.30)

【出願番号】特願2002-81290(P2002-81290)

【国際特許分類第7版】

B 05 C 7/04

B 05 C 9/14

B 05 C 11/10

B 05 C 13/02

B 05 D 3/00

B 05 D 3/02

B 05 D 7/22

H 01 J 9/22

【F I】

B 05 C 7/04

B 05 C 9/14

B 05 C 11/10

B 05 C 13/02

B 05 D 3/00 C

B 05 D 3/02 Z

B 05 D 7/22 F

B 05 D 7/22 T

H 01 J 9/22 D

H 01 J 9/22 F

【手続補正書】

【提出日】平成16年8月31日(2004.8.31)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0046

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0046】

したがって、第1ヒーター2の温度を低くすることで、薄い膜厚の塗膜5aを形成することができ(図4(a)参照)、第1ヒーター2の温度を高くすることで、厚い膜厚の塗膜5bを形成することができる(図4(b)参照)。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0055

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0055】

図7は塗膜の厚さに分布を持たせるとともに細管を冷却することで液溜りの位置を制御する例を示す説明図である。

本例においては、図5に示した方法を適用し、細管1の円周方向における厚さを変えて、細管1の内面に、薄い膜厚の塗膜5aと厚い膜厚の塗膜5bを形成する。そして、同時に、細管1を冷却装置8で冷却することで、液溜りの位置を制御する。冷却装置8を配置

する位置は、図6(a)～図6(c)で示した例と同じである。